

Микроскопный блок серии FS70

Серия 378 - Микроскопный блок для контроля полупроводников

- Отличные рабочие показатели благодаря вращающейся внутрь револьверной головке и высококачественным линзам длиннофокусного объектива.
- Эффективны в качестве инструмента для исследования полупроводников.
- Модели L- и L4- поддерживают длины волн ИАГ лазера от 266 до 1064 нм, позволяя производить лазерную резку тонких плёнок и жидкокристаллических подложек
- Эргономичный дизайн с комбинированной ручкой для грубой и тонкой настройки фокуса.



Модель	FS70	FS70-TH	FS70Z	FS70Z-TH
№	378-184-1	378-184-3	378-185-1	378-185-3
Модель с корот. базой	FS70-S	FS70-THS	FS70Z-S	FS70Z-THS
Артикул № модель с короткой базой	378-184-2	378-184-4	378-185-2	378-185-4
Козфф. оптического пропускания	50/50	50/50	50/50	50/50
Линза трубки	1X	1X	1X, 2X zoom	1X, 2X zoom
Крепление камеры	Крепление C-mount (с использованием опционального адаптера B)	Крепление C-mount (с использованием опционального адаптера B)	Крепление C-mount (с использованием опционального адаптера B)	Крепление C-mount (с использованием опционального адаптера B)
Нагрузка (*), кг	14,5	13,6	14,1	13,2
Масса кг	6,1	7,1	6,6	7,5

(*1) Нагрузка на оптическую трубку без учета массы объективов и окуляров.

Модель	FS70L	FS70L-TH	FS70L4	FS70L4-TH
№	378-186-1	378-186-3	378-187-1	378-187-3
Модель с корот. базой	FS70L-S	FS70L-THS	FS70L4-S	FS70L4-THS
Артикул № модель с короткой базой	378-186-2	378-186-4	378-187-2	378-187-4
Козфф. оптического пропускания	100/0 / 0/100	100/0 / 0/100	100/0 / 0/100	100/0 / 0/100
Защитный фильтр	Встроенный фильтр лазерного луча	Встроенный фильтр лазерного луча	Встроенный фильтр лазерного луча	Встроенный фильтр лазерного луча
Линза трубки	1X	1X	1X	1X
Применимый лазер	1064/532//355 нм	1064/532/355 нм	532/266 нм	532/266 нм
Крепление камеры	Используйте лазер с портом TV.	Используйте лазер с портом TV.	Разъем крепления C-mount (с переключателем зеленого фильтра)	Разъем крепления C-mount (с переключателем зеленого фильтра)
Объектив, опцион. (для лазерной резки)	M/LCD Plan NIR M/ LCD Plan NUV	M/LCD Plan NIR M/ LCD Plan NUV	M Plan UV	M Plan UV
Нагрузка (*), кг	14,2	13,5	13,9	13,1
Масса кг	6,4	7,2	6,7	7,5

(*1) Нагрузка на оптическую трубку без учета массы объективов и окуляров.

Спецификация

Регулировка фокуса	Метод : с помощью концентрических маховиков грубой и плавной фокусировки (справа и слева) Диапазон : диапазон перемещения 50 мм, 0,1 мм/об. для грубой регулировки, 3,8 мм/об. для грубой регулировки
Тринокулярное изображение трубки	Прямое изображение
Расстояние между зрчками	Тип Зидентоф, диапазон регулировки: 51-76 мм
Номер поля	24
Угол наклона	0°- 20° (только модели - TH, - THS)
Система освещения	Отраженное освещение для светлого поля (подсветка Келлера, с апертурной диафрагмой)
Источник света	12 В / 100 Вт, оптоволоконное, непрерывная регулировка, длина световода 1,5 м, потребляемая мощность 150 Вт
Объектив (опция)	M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo
FS-70L/L4	<ul style="list-style-type: none"> • FS70L поддерживает три длины волны ИАГ лазера (1064 нм, 532 нм и 355 нм), а FS70L4 поддерживает две длины волны (532 нм и 266 нм), что позволяет расширить сферу применений лазеров, позволяя лазерную резку тонких пленок, используемых в полупроводниках и жидких кристаллических подложках. Тем не менее, Mitutoyo не несет никакой ответственности за любой сбой производительности и / или безопасности лазерной системы, используемой с микроскопами Mitutoyo. Тщательное исследование рекомендуется при выборе лазерного излучателя. • Светлое поле, дифференциальный интерференционный контраст (DIC) и наблюдения в поляризованном освещении являются стандартными для FS70Z, FS70L и FS70L4 не поддерживают DIC метод. • При использовании наклоненной внутрь револьверной головки длиннофокусные объективы обеспечивают отличную работоспособность.



См. брошюру по микроскопным блокам и объективам